

MPI TS2000-SE | ShieldEnvironment™付200 mmオート・プローブシステム

DC/CV、RF、ミリ波測定用オート・プローブシステム

ShieldCap™

- 構成変更が用意で便利なシールド機構
- 最大RF4ポートまたはDC/カルテックス8ポートまで搭載可能
- プローブ・カードも対応

プローブ・プラテン

- 高剛性、安定設計
- RFポジション用角型調整器
- 熱安定を高めるエアクーリング機構
- 修理・メンテナンス用独自設計

ShieldEnvironment™

- EMIシールド、遮光環境により、超低ノイズ・低キャパシタンス測定を実現
- 広い前面ドアよりIC/ウエハの出し入れが簡単

モジュラー式チャック

- さまざまな常温、温度チャック
- トライアキシャル/同軸チャックより選定
- 広温度範囲に対応可能
(下限温度-60℃から上限温度300℃まで)
- フィールドにてアップグレード可能

RFキャリブレーション

- 校正基板用2つの補助チャック
- 高精度な校正のためのセラミック材質
- 平坦度1 μm (高コンタクト精度)

Safety Test Management™ (STM) System

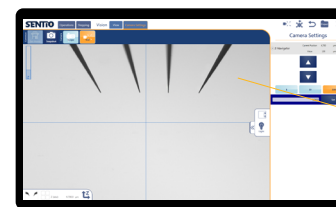
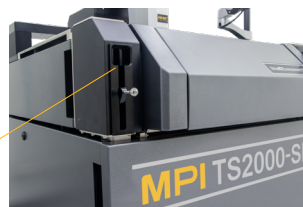
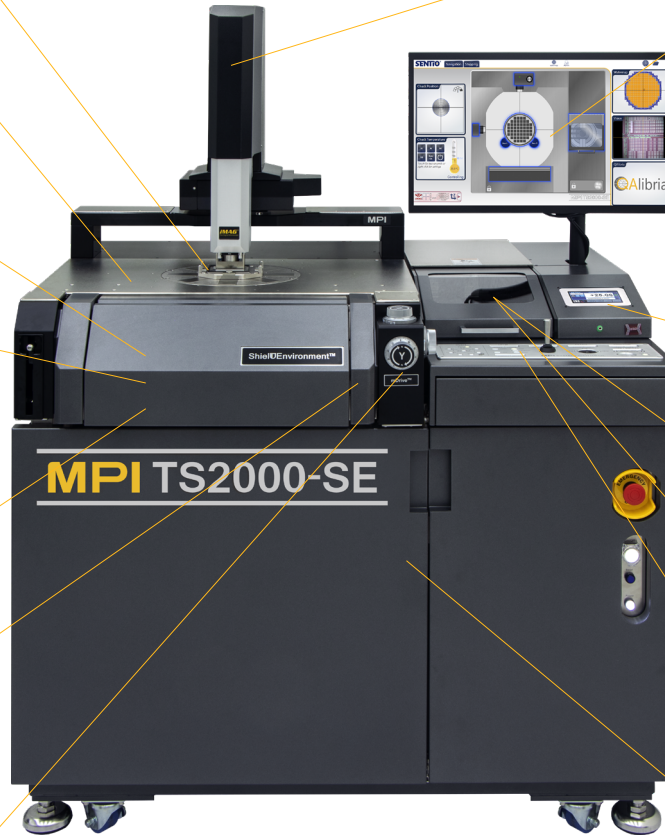
- さまざまな温度下において測定環境が守られ、安全で、信頼性の高い測定が可能に
- 露点コントロール機能により低温での測定を安定に実施
- 自動でCDAあるいは窒素の流量を監視
- 流量不足や流れが止まるなどの問題が起こった場合、自動的にチャックをセーフモードに切り替え

mDrive™ オプション

- チャック、顕微鏡、マイクロポジションなど、既存のプログラム可能なステージを直感的に手動操作可能
- 選択したステージのX軸、Y軸微調整機能
- Z軸の安全機能を使用するには、追加の有効化操作が必要

Probe Hover Control PHC™ オプション

- 手動でプローブをウエハにコンタクトおよびセパレーション可能
- SENTIO®により、1 μmまでの分解能を確保



顕微鏡および顕微鏡オプション

- 堅牢なプログラマブル顕微鏡ブリッジ・マウント (50 x 50 x 140 mm)
- さまざまな顕微鏡より選定可能 (単眼鏡筒、デジタル顕微鏡など)

プローブシステム制御ソフトウェアSENTIO®

- 簡単で直感的な操作、画期的なマルチ・タッチ式コントロールによりトレーニング時間を大幅に削減
- スクロール、ズーム、ムーブコマンドはスマートフォンの操作と似ているため誰でもすぐに操作が可能
- 現在使用中のアプリケーションから他のアプリケーションへの移動は指をスワイプするだけで可能
- RF校正用ソフトウェアQAibria®はSENTIO®と完全統合されており、同じコンセプトのもとに設計されているため、非常に簡単に使いこなすことが可能
- リモート制御用GPIB、TCP/IPインタフェース

温度制御

- 組み込まれたタッチパネルにより温度制御
- 暗箱前面にタッチパネルを設置することにより簡単にすぐに温度の制御が可能に

シングル・ウエハ・ローダー

- 自動測定のためのプリアライメント機能ウエハ・ローディング
- 100/150/200 mmウエハに対応

高低温時ウエハ交換が可能に

- どのチャック温度でもウエハのロード/アンロードが可能
- ダウンタイムが大幅に削減され、効率的な測定が可能

ハードウェア・コントロール・パネル

- より早く、より安全に、より簡単にプローブシステムを制御できるようコントロール系統が集約
- キーボードおよびマウスは操作しやすい位置に。またWindows®ベースの計測器も制御可能

高性能防振機構

- 高性能防振プラットフォームと一体型
- 省スペース設計
- 測定器用トレーの設置により、ケーブル長を短くし、測定をより確実に (オプション)

Vertical Controlled Environment™ (VCE) オプション

- VCE™により、プローブチップの側面を観測し、プローブカードのチップ・ドロップに関係なく、コンタクト位置の自動化が可能
- プローブカード、RF、DCプローブの安全使用の確保